

走査型白色干渉顕微鏡

VS1000 Series

Coherence Scanning Interferometry

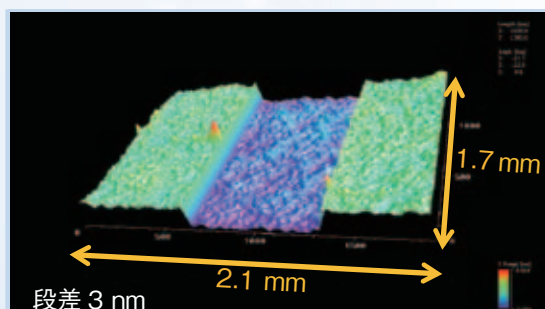
走査型白色干渉顕微鏡 (CSI) で解決しませんか？



VS1330外観

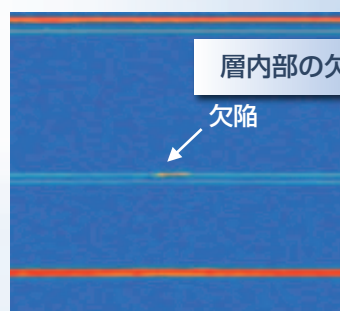
- 高さ分解能を落とさず、広範囲を測定したい
- 測定データの信憑性(再現性)を上げたい
- うねり・粗さの測定を実現したい
- 高アスペクト比の形状測定を行いたい
- 安定した透明体膜厚測定を実現したい
- フラットな表面から凹凸の大きい表面まで1台で計測したい

対物レンズ倍率に依存しない高さ分解能



薄膜段差 表面形状 ワンショット画像

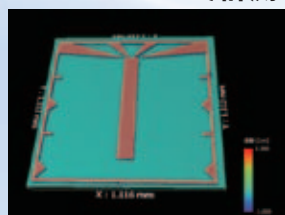
多層構造や層内部の欠陥評価が非破壊で可能



多層フィルム(偏光板)膜厚計測

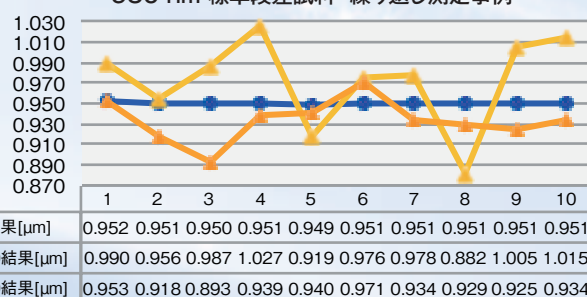
信頼性ある測定再現性

3σ : 1.8 nmで計測



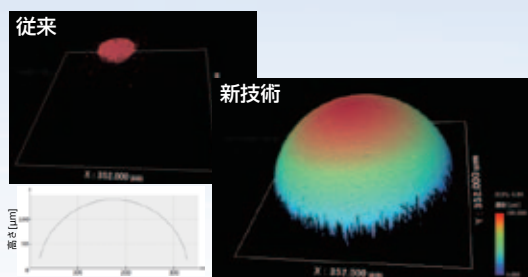
950 nm標準段差サンプル

950 nm 標準段差試料 繰り返し測定事例

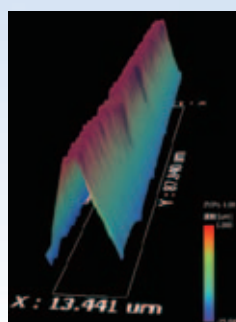


急峻な形状の測定を実現

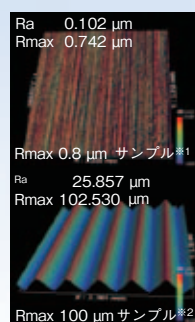
高傾斜測定 87°まで計測



φ400 μm SUS球



デザインナイフ刃先



粗さ標準片

